Research Paper

Optimization of Metal-dielectric-quasi metal High Reflection Mirrors in Infrared Wavelength¹

Maryam Gheshlaghi² and Somayeh Davodi³

Received: 2021.10.27 Revised: 2022.01.16 Accepted: 2022.02.19

Abstract

The purpose of this paper is an optimization of high reflection mirrors in the infrared wavelength. Infrared mirrors, in addition to being one of the main components of carbon dioxide lasers, are widely used in the flexible optical path or beam conduction. In the structure of these high reflection infrared mirrors, metal, dielectric are used as Glass/Metal/Dielectric/Ouasi and quasi-metal metal/Air. Separately the design of the high reflection mirror was investigated for each of the metals, dielectric and quasi-metal layers with different materials. In each step, the best type of material is selected based on the highest percentage of reflection. These layers are Silver (with a reflection of 99.87% in the structure of Glass/Metal/Air), magnesium fluoride (with a reflection of 98.31%) in the structure of Glass/Ag/MgF₂/Air), and Germanium (with a reflection of 99.88% in Structure Glass/Ag/MgF2/Ge/Air) for metal, dielectric and quasi-metal, respectively. Then, by changing the thickness of each layer, the optimal thicknesses for silver, magnesium fluoride, and germanium were determined to be 100, 550, and 200 nm, respectively. Examining the effect of angles of light incidence, it was observed that the highest average reflection is related to the angle of zero and 99.88%. The coating designs were done by McLeod coating software.

Keyword: Coating, High Reflection, Infrared, Carbon Dioxide Lasers, Quasi Metal.

³ M. Sc. Graduated, Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL), Tehran, Iran. Email: sdavodi@aeoi.org.ir





¹ DOI: 10.22051/ijap.2022.38823.1251

² Assistant Professor, Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL), Tehran, Iran. (Corresponding Author). Email: mgheshlaghi@aeoi.org.ir

مقالة پژوهشى

بهینهسازی آینههای تمامبازتاب فلز - دیالکتریک - شبهفلز در محدوده طول موج فروسرخ ۱ مریم قشلاقی*۲ و سمیه داودی۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران دانشکدهٔ فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۱۴۰۱ صص۳۱–۴۶

چکیده:

هدف این مقاله بهینه سازی آینه های تمام بازتاب در محدوده طول موج فروسرخ می باشد. آینه های فروسرخ علاوه بر اینکه یکی از اجزای اصلی لیزر گاز کربنیک می باشد، کاربرد گسترده ای در مسیر نوری قابل انعطاف یا هدایت پرتو دارند. در ساختار این آینه های تمام بازتاب فروسرخ از فلز، دی الکتریک و شبه فلز به صورت (شیشه/فلز/دی الکتریک/شبه فلز/هوا) استفاده می شود. به طور جداگانه طراحی لا یه نشانی آینه تمام بازتاب برای هر یک از لا یه های فلزی، دی الکتریک و شبه فلز با مواد مختلف بررسی شد. در هر مرحله بهترین نوع فلز/هوا)، فلوراید منیزیم (با بازتاب انتخاب شد. این لا یه ها نقره (با بازتاب ۹۹/۸۷ درصد در ساختار شیشه/ فلز/هوا)، فلوراید منیزیم (با بازتاب انتخاب شد. این لا یه ها نقره (با بازتاب ۹۹/۸۷ درصد در ساختار شیشه/ بازتاب ۸۹/۸۷ درصد در ساختار شیشه/نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) به ترتیب برای فلز، دی الکتریک و شبه فلز هوا)، فلوراید منیزیم (با بازتاب انتخاب شد. این لا یه ها نقره (با بازتاب ۹۹/۸۷ درصد در ساختار شیشه/ بازتاب ۸۹/۸۸ درصد در ساختار شیشه/نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) به ترتیب برای فلز، دی الکتریک و شبه فلز هستند. سپس با تغییر ضخامت هر یک از لا یه من خامت بهینه برای نقره، فلوراید منیزیم و ژرمانیم به ترتیب ۱۰۰، ۵۵۰ و ۲۰۰ نانومتر تعیین شد. با بررسی تأثیر زاویه تابش، ملاحظه گردید که متوسط در مافزار لا یه نشانی درصد بازتاب مربوط به زاویه صفر و ۸۹/۹۹ درصد می باشد. طراحی های لا یه نشانی توسط نرم افزار لا یه نشانی مکلؤد صورت گرفت.

واژ گان کلیدی: لایه نشانی، تمام بازتاب، فروسرخ، لیزر گاز کربنیک، شبه فلز.

[&]quot;استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی، تهران، ایران. (نویسندهٔ مسئول).Email: mgheshlaghi@aeoi.org.ir "دانش آموختهٔ کارشناسی ارشد، پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی، تهران، ایران.email: sdavodi@aeoi.org.ir





¹ DOI: 10.22051/ijap.2022.38823.1251

۱.مقدمه

آینههای فروسرخ آینههایی نوری هستند که برای بازتاب بیشتر طیف فروسرخ (IR) طراحی شدهاند. این آینهها دارای کاربرد وسیعی بوده و در حوزههای گوناگون نظامی، پزشکی و صنعتی جهت تغییر مسیر نوری یا کنترل پرتو استفاده میشوند. طولموج فروسرخ از فروسرخ نزدیک^۱ تا فروسرخ دور^۱ شامل طولموجهای بین ۰/۸ تا ۱۰ میکرومتر (فروسرخ نزدیک ۸/۰ تا ۲ میکرون) فروسرخ متوسط ۳ تا ۵ میکرون و فروسرخ دور ۸ تا ۱۱ میکرون) است [۱].

یکی از مهمترین کاربردهای آینههای فروسرخ در لیزرهای گاز کربنیک است. لیزرهای گاز کربنیک از دسته پرکاربردترین لیزرهای قدرت به شمار می آیند که با توجه به ساختار این لیزر با ارزش، امکان ساخت کامل آن در کشور وجود دارد [۲]. آینههای موجود در کاواک لیزر گاز کربنیک یکی از قسمتهای مهم این لیزر بشمار می آید که باید علاوه بر بومی سازی، امکان تعمیر و فناوری ساخت آن را نیز در داخل کشور فراهم کرد. سطح این نوع آینهها نسبت به کاربرد آن، به مرور زمان آسیب یافته و باید تعویض شوند. ساختار این نوع آینهها چندلایه است و به مواردی چون؛ نوع، توان بازتاب، ضخامت، جنس لایهها بستگی دارد. در برخی موارد توان بازتاب مورد نظر را می توان با ساختار یک لایهای بدست آورد، اگرچه به دلیل آستانه آسیب پایین، برای لیزر پرقدرت گاز کربنیک مناسب نیستند [۳]. آینههایی با ساختار فلزی مانند نقره، مس، طلا و آلومینیوم برای بهبود ویژگی های نوری ساخته شدند. این فلزات در مقیاس نانو دارای جذب نوری بسیار پایینی در

آینههای فلزی از جنس نقره، که اغلب در لیزر نوار پهن استفاده می شود، بازتاب بالایی از ۵۰۰ – ۸۰۰ نانومتر دارند. آینههای فلزی از جنس طلا برای کاربردهای در طول موج ۷۵۰– ۱۵۰۰ نانومتر ایده آل هستند [۷، ۸]. در برخی موارد پوشش بازتابی این آینه ها شامل نقره، طلا یا دی الکتریک است [۹، ۱۰]. آینه هایی با لایه نشانی دی الکتریک به منظور ارائه بازتاب بهینه در طول موج های لیزری مورد نظر به کار می روند. همچنین تحقیقات زیادی در زمینه طراحی و ساخت آینه های تمام بازتاب در محدوده های تابشی مختلف انجام شده است [۱۰ – ۱۱].

آینههای تمامبازتاب در محدوده طولموج فروسرخ ، با لایهنشانی فلز، دیالکتریک و شبهفلز به صورت (شیشه/فلز/ دی الکتریک/ شبه فلز/ هوا)^۳یا به اختصار (M/D/Q) ساخته می شوند. با تغییر

³ Glass/Metal/Dielectric/Quasi metal/Air





¹ Near Infra-Red (NIR)

² Longwave Infra-Red (LWIR)

۳۳/ بررسی بهینهسازی آینههای تمام،ازتاب فلز – دیالکتریک– شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

نوع و ضخامت هر یک از لایهها (فلز، دیالکتریک و شبهفلز) می توان تغییرات پاسخ نوری بازتاب را تغییر داد [۱۵، ۱۶]. همچنین تغییر زاویه تابش در آینههای تمامبازتاب در محدوده طولموج فروسرخ بر ویژگیهای اپتیکی آینه از جمله درصد بازتاب موثر میباشد. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی پاسخ نوری آینههای تمام فلز، سپس آینههای فلز، دیالکتریک و در نهایت آینههایی فلز، دیالکتریک، شبهفلز پرداخته شد که با استفاده از نرمافزار لایهنشانی مک-لئود^۱ شبیهسازی شدهاند. در هر مرحله با تغییر نوع مواد لایهنشانی، مقایسهای بین آنها صورت گرفته، سپس تاثیر جنس لایهها و بعد ضخامت لایهها و در نهایت زاویه تابش در آینههای تمام بازتاب در بازه فروسرخ میانی بررسی شد.

۲. مبانی نظری

انتشار امواج الکترومغناطیسی از قطعهای اپتیکی متشکل از لایههای متناوب از مواد شفاف با ضرایب شکست مختلف به شرح زیر است. سیستم به صورت متناوب در جهت محور Z و در صفحه X-y همگن است (شکل ۱). مشخص است که معادله هلمهولتز برای ترتیب متناوب یک فیلم چندلایه به صورت معادله (۱) است [۱۷]:

 $\vec{\nabla}^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_r \mu_r \vec{E} = 0$ (1) $r = 1,2 \ \epsilon_r \, \omega_r \, \omega_r \, \delta_r \, \omega_r \, \delta_r \, \omega_r \, \delta_r \, \delta_$



شکل ۱ (الف) شماتیک ساختار قطعه اپتیکی تک بعدی و (ب) نمای جانبی از ساختار قطعه اپتیکی.



1 Macleod



فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران، دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۳۴/۱۴۰۱

فرض کنید موج الکترومغناطیسی در جهت z پخش شود و جهت قطبش در امتداد محور x است. برای راحتی، میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی با یک تابع E (z ، x) به شرح معادله (۲) است:

$$E(z,x) = \left(A_j e^{ik_j z} + B_j e^{-ik_j z}\right) e^{i\beta x} \tag{(1)}$$

 $\beta = k_j = \frac{\omega}{c} n_j \cos \theta_j \quad \text{(so } \theta_j$

$$\vec{H} = i \frac{1}{\omega \mu} \vec{\nabla} \times \vec{E} \tag{(r)}$$

حل معادله (۱) ترکیب سطوح موجی است که از سمت چپ به سمت راست حرکت می کنند. یعنی برای لایهای با شاخص n₁ سطوح موج سمت راست و چپ به ترتیب دامنه های A₁ و B₁ دارند. بنابراین، برای لایه متناوب محیط ها با ضریب شکست n₁ و n₂ حل معادله (۲) به ترتیب به شرح زیر است:

$$E(z) = A_1 e^{ik_1 z} + B_1 e^{-ik_1 z}$$
(*)

$$E(z) = C_1 e^{ik_2(z-d_1)} + D_1 e^{-ik_2(z-d_1)}$$
(a)

اعداد موج k_1 و k_2 توسط $j = \frac{\omega}{c} n_j \cos \theta_j$ داده شدهاست که j = 1,2 معادلات (۲) و (۳) در سطح تماس بین لایهها پیوسته هستند ($z = d_1$). از این رو می توانیم بین دامنه امواج صفحهای رابطه (۶) را بدست آوریم:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ D_1 \end{pmatrix} = M_1 \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}$$
 (9)

$$M_{1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{k_{1}}{k_{2}} \right) e^{i\delta_{1}} & \frac{1}{2} \left(1 - \frac{k_{1}}{k_{2}} \right) e^{-i\delta_{1}} \\ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{k_{1}}{k_{2}} \right) e^{i\delta_{1}} & \frac{1}{2} \left(1 + \frac{k_{1}}{k_{2}} \right) e^{-i\delta_{1}} \end{pmatrix}$$
(V)

n1 که $\delta_1 = \frac{\omega n_1 d_1}{c} \cos \theta_1$ و در مرز بین محیطها با لایه های متناوب با ضریب شکست $\delta_1 = \frac{\omega n_1 d_1}{c} \cos \theta_1$ (z=d) می توان نوشت:





۳۵/ بررسی بهینهسازی آینههای تمام،بازتاب فلز – دیالکتریک– شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = M_2 \begin{pmatrix} C_1 \\ D_1 \end{pmatrix} \tag{A}$$

ماتریس M₂ همان ماتریس M₁ با تغییر اندیس ها است. با استفاده از معادلات ۷ و ۸، معادله ماتریس تبدیل را برای یک واحد داریم:

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = M_{i,j} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}$$
(9)

$$m_{11} = e^{i\delta_1} \left[\cos \delta_2 + \frac{1}{2}i \left(\eta + \frac{1}{\eta} \right) \sin \delta_2 \right]$$
(1.)

$$m_{12} = e^{-i\delta_1} \left[\cos \delta_2 + \frac{1}{2}i\left(\eta - \frac{1}{\eta}\right) \sin \delta_2 \right] \tag{11}$$

با $m_{22} = \overline{m}_{11}$ و $m_{12} = \overline{m}_{21}$ ، $\delta_2 = \frac{\omega n_2 d_2}{c} \cos \theta_2$ و $m_{12} = \frac{m_1 d_1}{c} \cos \theta_1$ ب با $m_{12} = \overline{m}_{21}$ ، $\delta_2 = \frac{\omega n_1 d_2}{c} \cos \theta_2$ و $m_{12} = \frac{m_1 \cos \theta_1}{c}$ برای مد TE. برای تناوب شبکه الارد $m_K(z)$ مد $m_K(z)$ مد TE. برای مد TE. $m_K(z) = \frac{n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2}$ $u_K(z) = u_K(z)e^{iK(\omega)z}$ که $(z, K) = u_K(z)e^{iK(\omega)z}$ $d = d_1 + d_2$ مختاط از سلول واحد است که $d = d_1 + d_2$. با در نظر گرفتن ساختار تناوبی لایه ها، ضرایب جملات توسط ضرب ماتریس های تبدیل هر واحد بدست می آید:

$$\begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \left(M_{i,j} \right)_1 \times \left(M_{i,j} \right)_2 \dots \left(M_{i,j} \right)_N \begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix}$$
 (17)

می توان ضریب باز تاب سیستم را با استفاده از رابطه (۱۳) بدست آورد.
$$r = \left(\frac{B_0}{A_0}\right)_{B_N=0}$$

مقدار مطلق ضريب بازتاب $R = r^*r$ است.

بازتاب بالا در لایه های دی الکتریک می تواند از لایه نشانی چندین لایه ربع موج از مواد دی الکتریک با ضرایب شکست بالا و پایین که به صورت تناوبی در کنار هم قرار گرفته اند، بدست آید. ضرایب عبور و انتقال بر اساس فرمول های فرنل در محیط های دی الکتریک مقادیر متناهی و حقیقی دارند که با محاسبه آن ها (r و t) می توان انرژی عبوری و انعکاسی را بدست آورد. برای تابش عمودی داریم [۴]:





فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران، دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۳۶/۱۴۰۱

$$\mathfrak{R}_p = \mathfrak{R}_s = \left|\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right|^2 \tag{1F}$$

$$\mathfrak{I}_p = \mathfrak{I}_s = \frac{4n_1n_2}{(n_1 + n_2)^2} \tag{10}$$

$$\Re = \frac{r_1^2 + 2r_1r_2\cos 2\delta_1 + r_2^2}{1 + 2r_1r_2\cos 2\delta_1 + r_1^2r_2^2} \tag{19}$$

$$\mathfrak{I} = \frac{n_2}{n_1} \times \frac{t_1^2 t_2^2}{1 + 2r_1 r_2 \cos 2\delta_1 + r_1^2 r_2^2} \tag{1V}$$

$$\tan \Psi = \frac{-r_2(1-r_1^-)\sin 2\delta_1}{r_1(1+r_2^2)+r_2(1+r_1^2)\cos 2\delta_1} \tag{1A}$$

$$\tan \gamma = \frac{(1+p_2)\tan \theta_1}{1+r_1r_2} \tag{19}$$

اندیسهای ۱ و ۲ مربوط به محیطهای اولیه و ثانویه گذار پرتو نور میباشند. کمیت δ فاز حرکت
موج در محیط و کمیتهای
$$\Psi$$
و γ به ترتیب اختلاف فاز انعکاس و عبور پرتو نور است. همچنین
ضخامت تک لایه برروی زیرلایه با رابطه (۲۰) بدست می آید [۱۸]:
 $d(r) = \lambda/4\pi n_f \cos^{-1} \left\{ \frac{[1+r_1^2 r_2^2]R(r)-r_1^2-r_2^2}{2r_1r_2(1-R(r))} \right\}$

که در آن
$$r_2 = (n_f - n_s)/(n_f + n_s)$$
 و $r_1 = (1 - n_f)/(1 + n_f)$ ضرایب فرنل
میباشند و n_s ضریب شکست زیرلایه و n_f ضریب شکست لایه نازک است. این رابطه برای حالت
چند لایه پیچیده تر می شود که می تواند از تئوری تداخل در ساختارهای فیلم نازک محاسبه شود
[۱۹].

حال برای دو لایه فلز و دیالکتریک روی زیرلایه شیشه، نور از هوا $(n_1 = 1)$ بر روی یک فیلم نازک با ضخامت h و ضریب شکست مختلط $ik_2 = n_2 + ik_2$ ، که روی یک لایه فلزی با ضریب شکست مختلط n_3 انباشت شده است، بر خورد می کند. ضریب بازتاب برای پلاریزاسیون S نوری فرودی با زاویه β با فرمول ۲۱ محاسبه می شود [۲۰]:

$$\tilde{r} = \frac{\tilde{r}_{12} + \tilde{r}_{23} e^{2i\beta}}{1 + \tilde{r}_{12} \tilde{r}_{23} e^{2i\beta}} \tag{(Y1)}$$





۳۷/ بررسی بهینهسازی آینههای تمامبازتاب فلز – دیالکتریک – شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

$$\tilde{r}_{mn} = \frac{\tilde{p}_m - \tilde{p}_n}{\tilde{p}_m + \tilde{p}_n} \tag{(YY)}$$

$$\tilde{p}_m = \tilde{n}_m \cos \tilde{\theta}_m \tag{YT}$$

$$\beta = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) \tilde{n}_2 h \cos \tilde{\theta}_2 \tag{YF}$$

$$\tilde{\theta}_m = \sin^{-1} \left(\frac{\sin \theta_1}{\tilde{n}_m} \right) \tag{YD}$$

که شکل مختلط قانون اسنل است. برای پلاریزاسیون p نوری فرودی، مولفه
$$ilde{p}_m$$
 با $ilde{q}_m$ جایگزین
میشود، که از فرمول (۲۶) بدست میآید:
(۲۶)
و در اینجا نیز مانند روابط چند لایه دیالکتریک، بازتاب کل با رابطه $| ilde{r}|^2 = R$ مشخص
میشود.

۳. تأثير جنس لايه فلزى

و

ابتدا طراحی لایه نشانی فلزاتی چون آلومینیوم، نقره، زیر کونیوم، طلا، تیتانیم، آهن، نیکل، سرب و مس با ضخامتهای یکسان (۱۰۰ نانومتر) روی زیرلایه شیشه انجام شد و درصد بازتاب در محدوده ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر با هم مقایسه شد (شکل۲).



شکل ۲ نمودار درصد بازتاب بر حسب طولموج برای طراحی لایهنشانی (شیشه/ فلز/ هوا) با فلزات مختلف در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر.



فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران، دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۳۸/۱۴۰۱

همان طور که ملاحظه می شود فلز نقره (Ag) نسبت به دیگر فلزات، دارای بیشترین درصد بازتاب در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر می باشد، در حالی که فلز تیتانیوم (Ti)، در این بازه دارای کمترین درصد بازتاب می باشد. درصد بازتاب برای چهار فلز آلومینیوم (Al)، نقره (Ag)، طلا (Au) و مس (Cu) از باقی فلزات بیشتر است. در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر، متوسط درصد بازتاب طراحی لایه نشانی (شیشه/ فلز/ هوا) برای فلز آلومینیوم، نقره، طلا و مس به ترتیب ۹۹/۶۴، ۹۹/۸۷، ۹۹/۷۹ و ۱۹۹/۷۱ درصد است. بنابراین فلز نقره دارای بالاترین مقدار درصد بازتاب برای طراحی لایه نشانی بالا است.

۴. تأثير جنس لايه دىالكتريك

به دلیل استفاده از دیالکتریک در طراحی لایهنشانی آینه فروسرخ ، ابتدا مقایسهای از درصد بازتاب لایهنشانی دیالکتریکهای مختلف به ترتیب، دیاکسید سیلیکون (SiO2)، فلورید منیزیم (MgF2)، دیاکسید هافنیم (HfO2) و اکسید یوتریم (Y2O3) با ضخامتهای یکسان (۵۰۰ نانومتر) روی زیرلایه شیشه برحسب طول موج در بازه ۷۵۰ تا ۹۰۰۰ نانومتر انجام شد. ملاحظه شد که درصد بازتاب برای دیالکتریکهای بالاکم و بیش یکسان می باشد.

بر روی لایه فلز، از یک نوع دی الکتریک به عنوان لایه محافظ استفاده می شود، دی الکتریک های مورد استفاده دی اکسید سیلیکون (SiO2)، فلورید منیزیم (MgF2)، دی اکسید هافنیوم (HfO2)، اکسید یوتریم (Y2O3)، دی اکسید زیرکونیم (ZrO2)، اکسید تانتالیم (Ta2O5)، دی اکسید تیتانیم (TiO2) و اکسید آلومینیم (Al2O3) می باشند. در نمودار شکل (۳)، درصد بازتاب طراحی لایه نشانی (شیشه/ نقره/ دی الکتریک/ هوا) بر حسب طول موج در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر برای دی الکتریک های مختلف نشان داده شده است. بیشترین درصد بازتاب مربوط به لایه نشانی (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ هوا) با بازتاب ۱۹۸۳ درصد است. در طراحی بالا، ضخامت نقره ۱۰۰ نانومتر و ضخامت لایه دی الکتریک ۵۰۰ نانومتر در نظر گرفته شد.







شکل ۳ نمودار درصد بازتاب بر حسب طولموج برای طراحی لایهنشانی (شیشه/ نقره/ دی الکتریک/ هوا)، با دی-الکتریکهای مختلف در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر.

د. تأثير جنس لايه شبه فلز

به این دلیل که با افزودن لایه محافظ درصد بازتاب کم می شود برای افزایش درصد بازتاب نیاز به یک لایه شبهفلز به عنوان لایه سوم، داریم. از آنجاییکه شبهفلزاتی چون ژرمانیم (Ge)، سیلیکون (Si)، سلناید روی (ZnSe) و سولفید روی (ZnS) در بازه فروسرخ دارای بازتاب بالا می باشند، این شبهفلزات در طراحی لایهنشانی (شیشه/نقره/فلورید منیزیم/ شبه فلز/ هوا) انتخاب شدند. در این طراحی ضخامت نقره ۱۰۰ نانومتر و ضخامت لایه فلورید منیزیم منه مانومتر و ضخامت لایه شبه فلز ۱۵۰ نانومتر در نظر گرفته شد.

در نمودار شکل (۴)، درصد بازتاب لایهنشانی شبهفلزات ژرمانیم، سیلیکون، سلناید روی و سولفید روی بر حسب طولموج در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر رسم شده است. در این نمودار ژرمانیم با بیشینه متوسط درصد بازتاب ۹۹/۸۹ درصد، سیلیکون ۹۹/۸۱ درصد، سلناید روی ۹۹/۴۷ درصد و سولفید روی با ۹۹/۲۹ درصد در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر نشان داده شده که لایهنشانی شبهفلز ژرمانیم دارای بیشترین درصد بازتاب است.





فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران، دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۴۰/۱۴۰۱



شکل ۴ نمودار درصد بازتاب بر حسب طولموج برای شبه فلزات مختلف در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر.

در نمودار شکل (۵)، بیشترین درصد بازتاب برای ترکیب آینه فروسرخ (شیشه/نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر، ۹۹/۸۷ درصد میباشد. از این رو انتخاب این ترکیب برای آینه فروسرخ در این بازه، مطلوب است.



شکل ۵ نمودار درصد بازتاب بر حسب طول موج برای طراحی لایهنشانی (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ شبه فلز/ هوا) با شبه فلزات مختلف در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تانومتر.

. تأثیر ضخامت لایهها در آینههای تمامبازتاب

30

پس از انتخاب نوع لایهها، ضخامت لایهها اهمیت دارد، چرا که علاوه بر حفظ درصد بازتاب بالا، جذب پایین نیز مورد توجه میباشد. از این رو در این بخش، با انتخاب نوع ترکیب برای آینه



۴۱/ بررسی بهینهسازی آینههای تمامبازتاب فلز – دیالکتریک – شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

فروسرخ ، به تاثیر ضخامت لایهها می پردازیم. در شکل (۶)، درصد بازتاب آینه فروسرخ انتخابی فلز، دی الکتریک و شبهفلز در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر، به ازای ضخامتهای مختلف، ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۵ نانومتر برای فلز نقره (Ag) به ترتیب ۹۹/۸۷، ۹۹/۸۷، ۹۹/۸۷ و ۹۹/۸۶ درصد را نشان می دهد. به این دلیل که ضخامتهای ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ نانومتر برای فلز نقره دارای درصد بازتاب میانگین یکسان هستند، برای کمتر شدن درصد جذب، پایین ترین ضخامت یعنی ۱۰۰ نانومتر را درنظر می گیریم.



شکل ۶ نمودار درصد بازتاب بر حسب طولموج برای ترکیب آینه فروسرخ با ضخامتهای مختلف فلز نقره در بازه با ۹۵۰۰ نانومتر.

در شکل (۷)، آینه فروسرخ انتخابی فلز، دیالکتریک و شبه فلز با ضخامتهای مختلف دیالکتریک MgF2 گزارش شده است. متوسط درصد بازتاب در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر، به ازای ضخامتهای مختلف ۶۰۰، ۵۵۰، ۵۰۰ و ۴۵۰ نانومتر برای MgF2 به ترتیب ۹۹/۸۷، ۹۹/۸۷، ۹۹/۸۶ و ۹۹/۸۵ درصد را نشان داد. از این رو، برای MgF2 ضخامت ۵۵۰ نانومتر را در نظر می گیریم.







شکل ۷ نمودار درصد بازتاب بر حسب طولموج برای ترکیب آینه فروسرخ با ضخامتهای مختلف MgF2 در بازه ۲۵۰۰ تا ۵۵۰۰ نانومتر.

در نمودار شکل (۸)، متوسط درصد بازتاب در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر، به ازای ضخامتهای مختلف، ۲۷۰، ۲۰۰، ۱۴۰ و ۱۰۰ نانومتر برای ژرمانیوم به ترتیب ۹۹/۸۶۹، ۹۹/۸۷۹، ۹۹/۸۱۷ و ۹۹/۶۸۳ درصد را نشان میدهد. در نتیجه بالاترین درصد بازتاب متوسط برای ضخامت ۲۰۰ نانومتر است.



شکل ۸ نمودار درصد بازتاب آینه فروسرخ برحسب طولموج در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر با ضخامتهای مختلف

شبەفلز ژرمانيم.





۴۳/ بررسی بهینهسازی آینههای تمامبازتاب فلز- دیالکتریک- شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

بهینهسازی ضخامت لایه ها بر اساس نمودارهای (۶) الی (۸) برپایه جدول (۱) است.

ضخامت (نانومتر)		نوع لايه	رديف
-	Air	هوا	١
۱۰۰	Ag	نقره	۲
00.	MgF ₂	فلوريد منيزيم	٣
۲.,	Ge	<u> ژر</u> مانيم	۴
-	Glass	زيرلايه	۵

جدول ا نوع و ضخامت لايهها در تركيب آينه فروسرخ (شيشه/ فلز/ دىالكتريك/ شبه فلز/ هوا).

در نمودار شکل (۹)، درصد بازتاب و جذب ترکیب انتخابی بالا برای آینه فروسرخ در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر رسم شده است، که درصد بازتاب و جذب به ترتیب برابر با ۹۹/۸۷۹ و ۱/۱۲ است.



۹۵۰۰ تا ۲۵۰۰ نمودار درصد بازتاب و جذب ترکیب انتخابی آینه فروسرخ بر حسب طول موج در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر.

۷. تأثیر زاویه تابش در آینه های تمامباز تاب شکل (۱۰)، درصد بازتاب آینه فروسرخ انتخابی فلز، دی الکتریک و شبه فلز برحسب زاویه های تابش مختلف نشان می دهد. متوسط بیشترین درصد بازتاب آینه فروسرخ به ازای زوایای تابش مختلف در بازه ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نانومتر در نمودار شکل (۱۱) نشان داده شده است.







شکل ۱۰ نمودار درصد بازتاب آینه فروسرخ در بازه ۲۵۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر برای زوایای تابش مختلف.



شکل 11 نمودار متوسط بیشترین درصد بازتاب آینه فروسرخ به ازای زوایای تابش مختلف.

نمودار شکلهای (۱۰) و (۱۱) نشان میدهد که آینه فروسرخ طراحی شده (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) برای زاویه تابش صفر و نزدیک آن بالاترین درصد بازتاب را دارد.

نتیجه گیری

برای بهینهسازی ساختار آینههای تمامبازتاب فروسرخ به صورت (شیشه/ فلز/ دی الکتریک/ شبه فلز/ هوا) به طور جداگانه طراحی لایهنشانی با نرم افزار مکلئود شبیهسازی شد و لایهنشانی آینه تمام بازتاب برای هر یک از لایههای فلزی، دی الکتریک و شبه فلز با مواد مختلف بررسی شد. ابتدا لایههای فلزی مختلف آلومینیوم، نقره، زیرکونیوم، طلا، تیتانیم، آهن، نیکل، سرب و مس در نظر





۴۵/ بررسی بهینهسازی آینههای تمامبازتاب فلز – دیالکتریک – شبهفلز در محدوده طولموج فروسرخ؛ مریم قشلاقی و سمیه داودی

گرفته شد. فلز نقره با بازتاب ۹۹/۸۷ درصد در ساختار (شیشه/ فلز/ هوا) بالاترین میزان بازتاب را داشت. سپس پاسخ نوری دیالکتریکهای مختلف دی اکسید سیلیکون (SiO2)، فلورید منیزیم (MgF2)، دی اکسید هافنیوم (HfO2)، اکسید یوتریم (Y2O3)، دی اکسید زیر کونیم (ZrO2)، اکسید تانتالیم (Ta2O5)، دی اکسید تیتانیم (TiO2) و اکسید آلومینیم (Al2O3) بررسی شد. منیزیم فلوراید با بازتاب ۹۸/۳۱ درصد در ساختار (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ هوا) بالاترین میزان بازتاب را نشان داد. در نهایت شبه فلزات مختلف ژرمانیم (Ge)، سیلیکون (SiO)، سلناید روی (ZnSe) و سولفید روی (ZnS) مورد بررسی قرار گرفت که شبه فلز ژرمانیم با بازتاب ۹۸/۸۸ درصد در ساختار (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) بیشترین بازتاب ۸۰/۸ درصد در ساختار (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) بیشترین بازتاب ۸۰/۱۰ درصد در ساختار (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) بیشترین بازتاب ۲۰۱۰ مراب در مانیم با بازتاب ۲۰۰۱ مراب درسی قرار گرفت که شبه فلز ژرمانیم با بازتاب ۹۸/۸۸ درصد در ساختار (شیشه/ نقره/ فلورید منیزیم/ ژرمانیوم/ هوا) بیشترین بازتاب را داشت. سپس با

منابع

- [1] Rahmlow T.D., Lazo-Wasema J.E., Wilkinsonb S., and Tinkerc F., Dual band antireflection coatings for the infrared, *Proc. of SPIE*, 6940, 69400T-1, 2008.
- [2] Endo M., and Walter R.F., Gas lasers, 1st ed., CRC Press, 2006.
- [3] Ichikawa Y., Yoshida K., Tsunawaki Y., Yamanaka M., Yamanaka T., Yamanaka C., Okamoto H., Matsusue N., and Kitajima K., Highly damage-resistant Mo mirror for high-power TEA CO2laser systems, *Applied optics*, 26, 3671-3675, 1987.
- [4] Chou C.H., Lin Y.T., Shinde S., Huang C.E., Wu T.C., Lin K.M., and Hsiao W.T., The development of a monitoring system for analyzing factors affecting film thickness in a sputtering process, *Modern Physics Letters B*, 34(07n09), 2040021, 2020.
- [5] Sinha M.K., Mukherjee S.K., Pathak B., Paul R.K., and Barhai P.K., Effect of deposition process parameters on resistivity of metal and alloy films deposited using anodic vacuum arc technique, *Thin Solid Films*, 515(4), 1753-1757, 2006.
- [6] Leftheriotis G., Papaefthimiou S., and Yianoulis P., Development of multilayer transparent conductive coatings, *Solid State Ionics*, 136, 655-661. 2000.
- [7] Gheshlaghi M., Maleki, M.H., Shafaei, S.R., and Hojjati rad, H., Study of laminated materials in the process of making gold interior mirrors, *The Second National Vacuum Conference of Iran*, 2007. (In Persion)
- [8] Gheshlaghi M.; Haririan Z., Maleki, M.H., and Hojjati rad, H., Optimization of gold reflectors on glass and quartz substrates and study of changes in its reflection in different angles of radiation, 15th Iranian Optics and Photonics Conference, 2008. (In Persion)
- [9] Li Q., Wei C., Chi H., Zhou L., Zhang H., Huang H., and Liu Y., Au Nano cages saturable absorber for 3-μm mid-infrared pulsed fiber laser with a wide wavelength tuning range, Optics Express, pp.30350-30359, 2019.
- [10] Bedford R., and fallahi M., Analysis of high-reflectivity metal-dielectric mirrors for edge-emitting lasers, *Optics Letters*, 29(9):1010-2, 2004.
- [11] Habel F., Advanced dispersive mirrors for ultrashort laser pulses from the near-UV to the mid-IR spectral range, München, den 15. 11. 2016





فصلنامهٔ علمی فیزیک کاربردی ایران، دانشگاه الزهرا، سال دوازدهم، پیاپی ۲۸، بهار ۴۶/۱۴۰۱

- [12] Wang Z., Cheng Y., Nie Y., Wang X., and Gong R., Design and realization of onedimensional double hetero-structure photonic crystals for infrared-radar stealthcompatible materials applications, *JOURNAL OF APPLIED PHYSICS*, 116, 054905, 2014.
- [13] Mao Q., Feng C., Yang Y., and Tan Y., Design of broadband metamaterial nearperfect absorbers in visible region based on stacked metal-dielectric gratings, *Mater. Res. Exp.*, 5, 6, 065801, 2018.
- [14] Gheshlaghi M., and Davoodi S., Design of Selective Low Emission Infrared Spectrum Layer Design, *13th Dense Matter Conference*, 2016. (In Persian)
- [15] Jon Nesari M., Zablian H., Firoozifar S.A., Mardiha M., and Ghaneie H., Design and fabrication of infrared mirrors with a combination of metal and all-dielectric thinlayer mirrors, *20th Iranian Optics and Photonics Conference*, 2013. (In Persian)
- [16] Gheshlaghi M., and Davoodi S., Study of the effect of layer thickness and radiation angle on all-infrared mirrors, 9th National Vacuum Conference of Iran, 1398. (In Persian)
- [17] Wang Z., Cheng Y., Nie Y., Wang X., and Gong R., Design and realization of onedimensional double hetero-structure photonic crystals for infrared-radar stealthcompatible materials applications, *JOURNAL OF APPLIED PHYSICS*, 116, 054905, 2014.
- [18] Emiliani G., Piegari A., De Silvestri S., Laporta P., and Magni V., Optical coatings with variable reflectance for laser mirrors, *Applied optics*, 28, 14, 1989.
- [19] Vidal B., Fornier A., and Pelletier E., Optical Monitoring of non-quarter wave Multilayer Filters, *Appl. Opt.*, 17, 1038-1047, 1978.
- [20] Born M., and Wolf E., Principles of Optics, 7th ed., Cambridge Uni. Press, 2003.
- © 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<u>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</u>).



